Сведения о планируемой календарной загрузке научного оборудования ЦКП НИЦ «Курчатовский институт» - ТИСНУМ «Исследования наноструктурных, сверхтвердых и углеродных материалов»

(Загрузка оборудования меняется динамически, временные границы выполнения конкретного заказа от пользователей определяется по мере поступления заявок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование единицы оборудования | Планируемое время работы оборудования, час | |
| 2024 | |
| Всего | В интересах третьих лиц |
| 1 | Рентгеновский комплекс исследования топографии | 1980 | 50% |
| 2 | Просвечивающий электронный микроскоп | 1980 | 50% |
| 3 | Установка измерения вольт- амперных и вольт- фарадных характеристик | 1980 | 50% |
| 4 | Ростовая установка на базе ДО-044 для отраб. техпроцесса синтеза синтетических алмазов | 1980 | 50% |
| 5 | Комплекс для проведения литографических операций и модификации поверхности алмаза с использованием лазерного излучения | 1980 | 50% |
| 6 | Автоматический электрогидравличес кий пресс для горячей запрессовки образцов. С комплектующими и расходными материалами Mecapress 3 Presi | 1980 | 50% |
| 7 | Лазерный маркировочно­обрабатывающий центр | 1980 | 50% |
| 8 | Оптический профилометр | 1980 | 50% |
| 9 | Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости | 1980 | 50% |
| 10 | Лазерный комплекс для высокоточной разметки и нагрева образцов аллотропных форм углерода с визуальным и радиометрическим контролем с  возможностью исследования фазовых переходов методом рамановской микроскопии | 1980 | 50% |
| 11 | Криостат заливной LN-121-SPECTR | 1980 | 50% |
| 12 | Ростовая установка на базе пресса GY850 (1 ед.) | 1980 | 50% |
| 13 | Комплект специализированного оборудования для возбуждения Рамановских спектров | 1980 | 50% |
| 14 | Система термического механического анализа вертикальной конструкции TMA 402 F1 Hyperion NETZSCH | 1980 | 50% |
| 15 | Комплекс для исследования магнитооптических и электрооптических свойств синтет. алмазов и др. широкозонных полупроводниковых материалов в диапазоне температур от 2 до 400 К | 1980 | 50% |
| 16 | 3D-сканер System Sense Next Gen 3D Systems | 1980 | 50% |
| 17 | Установка прототипирования 3D-принтер Form2 FormLabs | 1980 | 50% |
| 18 | Специализированное оборудование термической обработки в высокочистой среде | 1980 | 50% |
| 19 | Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный EDX3600H | 1980 | 50% |
| 20 | Хроматограф газовый "Кристаллюкс-4000М" в комплекте | 1980 | 50% |
| 21 | Многоканальный потенциостат-гальваностат Р-20Х8 с первичной поверкой | 1980 | 50% |
| 22 | Ростовая установка на базе пресса GY850 (1 ед.) | 1980 | 50% |
| 23 | Комплекс термомеханическог о анализа свойств образцов графитов, углеродных композитов, керамик, металломатричных углеродных композитов | 1980 | 50% |
| 24 | Лазерная многоволновая система для возбуждения и регистрации спектров фотолюминесценци и комбинационного рассеяния света в ультрафиолетовом (213 и 266 нм) и фиолетовом (405 нм) спектральных диапазонах | 1980 | 50% |
| 25 | Рамановский спектрометр- микроскоп 0914-20 Renishaw | 1980 | 50% |
| 26 | Прибор для ионной полировки (система ионного утонения) | 1980 | 50% |
| 27 | УНУ Рентгеновская установка (1 ед.) | 1980 | 50% |
| 28 | Сканирующий электронный микроскоп JSM-7600F (Jeol) | 1980 | 50% |
| 29 | Сканирующий зондовый микроскоп | 1980 | 50% |
| 30 | Микроскоп стереоскопический SZX2-ZB16 Olympus ( | 1980 | 50% |
| 31 | Прибор для определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS) | 1980 | 50% |
| 32 | Вакуумный Фурье- спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К | 1980 | 50% |
| 33 | Комплекс испытательного оборудования для исследования электромеханическ их свойств материалов в различных температурных условиях | 1980 | 50% |
| 34 | Машина универсальная напольная для электромеханическ их испытаний | 1980 | 50% |
| 35 | Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к изделиям | 1980 | 50% |
| 36 | Анализатор тепло- и температуропровод ности | 1980 | 50% |